

[11] Иванов А.И., Мохов Е.Н., Одинг В.Г.,
Вавилов В.С., Водаков Ю.А., Чуки-
чев В.К. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 17.
С. 38-41.

Поступило в Редакцию
12 марта 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 14

26 июля 1990 г.

11

© 1990

О РАСХОДЕ МАССЫ КОНИЧЕСКОГО ЭМИТТЕРА ПРИ ВЗРЫВНОЙ ЭМИССИИ ЭЛЕКТРОНОВ

В.Г. Месяц

Одной из важных характеристик взрывной электронной эмиссии (ВЭЭ) из металлов является расход массы материала катода. Обычно для исследования ВЭЭ используются конические острыйные эмиттеры (рис. 1). Для таких эмиттеров в сферической системе координат уравнение теплового баланса на катоде имеет вид [1]

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \nabla^2 T + \frac{i^2 \alpha(T)}{Q^2 r^4}, \quad (1)$$

где λ - теплопроводность, $Q = 4\pi \sin^2(\theta/4)$ - телесный угол, α - удельное сопротивление, c - теплоемкость, ρ - удельный вес металла, i - ток, r - радиус, отсчитываемый от вершины острия, θ - угол конуса эмиттера. Если использовать малое время $t \leq 10^{-8}$ с и угол $\theta \leq 20^\circ$, то можно пренебречь теплопроводностью, т.е. членом $\lambda \nabla^2 T$ в уравнении (1). Тогда мы получим чисто джоулев разогрев эмиттера. В этом случае распределение температуры запишется в виде

$$T = T_0 \exp\left(\frac{\alpha_0 \int_0^t i^2 dt}{Q^2 \rho c r^4}\right), \quad (2)$$

где T_0 - начальная температура эмиттера.

В (2) принята прямолинейная зависимость удельного сопротивления от температуры $\alpha = \alpha_0 T$, а также C считается независимой от температуры.

Обычно принимается, что уносится та масса, температура которой выше некоторой критической величины T_{kp} . Радиус r_{kp} ,

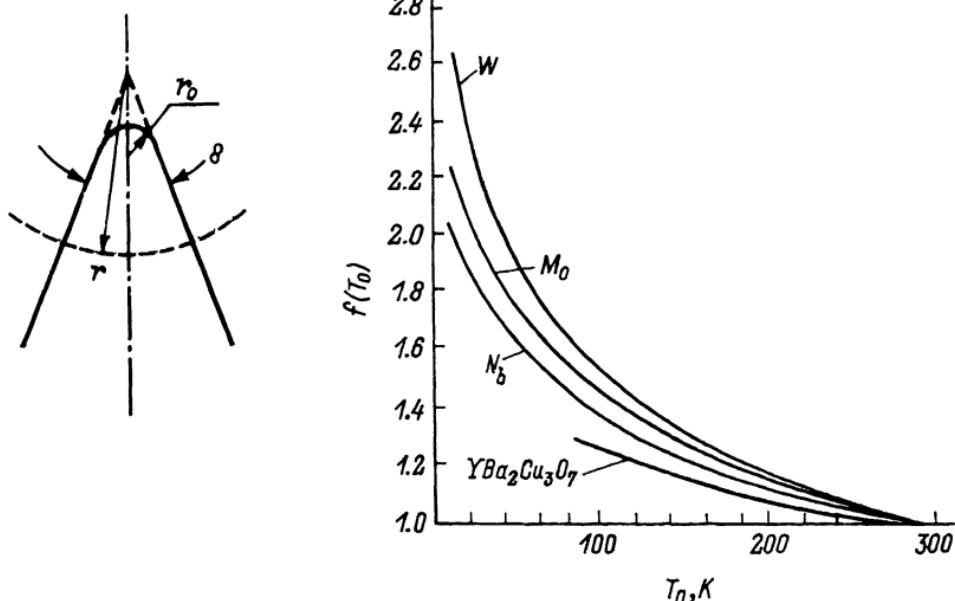


Рис. 1. Схема конического эмиттера для экспериментов по взрывной эмиссии электронов. θ – угол конуса, r – радиус, отсчитываемый от вершины острия ($r_0 \ll r$).

Рис. 2. Зависимость температурных функций $f(T_0)$ интеграла действия от начальной температуры катода T_0 для различных материалов катодов.

внутри которого находится уносимая масса, определяется из соотношения [2]

$$r_{kp} = \left[\frac{\alpha_0 \int_0^t i^2 dt}{\Omega^2 \rho c \ln(T_{kp}/T_0)} \right]^{1/4}, \quad (3)$$

где T_0 – начальная температура эмиттера.

Если принять, что радиус эмиттера $r_0 \gg r_{kp}$ (рис. 1), то масса, уносимая с катода, определяется из соотношения

$$\Delta M = \frac{1}{3} \rho r_{kp}^3 \Omega = \frac{\rho}{6\sqrt{\pi} \sin(\theta/4)} \left[\frac{\int_0^{t_u} i^2 dt}{(\rho c / \alpha_0) \ln(T_{kp}/T_0)} \right]^{3/4}, \quad (4)$$

где t_u – длительность импульса.

Величина, стоящая в знаменателе в квадратных скобках, является удельным интегралом действия h при взрыве цилиндрических проводников [2], т.е.

$$\int_0^{t_u} j^2 dt \approx \frac{\rho c}{\alpha_0} \ln \frac{T_{kp}}{T_0} = h, \quad (5)$$

Проводник	Cu	Al	Ag	Ni	Fe	Au	YBa
$h, A^2 \cdot s \cdot cm^{-4}$	$2 \cdot 10^9$	$1 \cdot 10^9$	$1 \cdot 10^9$	$0.7 \cdot 10^9$	$0.5 \cdot 10^9$	$0.5 \cdot 10^9$	3·1

где t_3 – время задержки взрыва проводника, j – плотность тока.

Значения h для различных металлов и иттрий-бариевых сверхпроводящих керамик с оптимальным содержанием кислорода приведены в таблице [2, 3]. Известно, что для многих проводников величина h в широком диапазоне плотностей тока и времен воздействия остается практически неизменной [2].

Подставляя (5) в (4), получим

$$\Delta M = \frac{\rho}{6\sqrt{x} \sin(\theta/4)} \left(\frac{\int_{t_0}^{t_u} i^2 dt}{h} \right)^{3/4}. \quad (6)$$

Из формулы (6) следует важный вывод: для двух геометрически одинаковых конических катодов (с одинаковым углом θ), с которых течет одинаковый ток, отношение объемов масс ΔV , уносимых в процессе ВЭЭ, определяется из соотношения

$$\frac{\Delta V_1}{\Delta V_2} = \left(\frac{h_2}{h_1} \right)^{3/4}. \quad (7)$$

Соотношение (6) объясняет, почему унос массы из высокотемпературной сверхпроводящей керамики почти на два порядка больше, чем из большинства металлов [4]. Это обусловлено малой величиной удельного интеграла действия h ВТСП керамики по сравнению с металлами (см. таблицу) [4]. Величина h зависит от начальной температуры эмиттера T_0 . Величины, приведенные в таблице, получены при комнатной температуре $T = 300$ К. Для определения зависимости $h(T_0)$ необходимо учесть, что при низких температурах α имеет гораздо более сложную зависимость от T . Кроме того, необходимо учитывать зависимость теплоемкости c от T . В общем виде величина для цилиндрического проводника записывается так:

$$h = \int_{T_0}^{T_{kp}} \rho \frac{c(T)}{\alpha(T)} dT. \quad (8)$$

Для определения зависимости $h(T_0)$ удобно интегрирование в (8) разбить на два интервала: первый – от T_0 до $T_k = 300$ К, а второй – от T_k до T_{kp} . В этом случае получим

$$h = h_k \left[1 + h_k^{-1} \int_{T_0}^{T_k} \rho(c/\alpha) dT \right], \quad (9)$$

где h_k – удельный интеграл действия при комнатной начальной температуре. Величину в скобках обозначим через $f(T_0)$ и назовем температурной функцией удельного интеграла действия. За-

висимости $f(T_0)$ для Nb, Mo, W и иттрий-бариевых ВТС! приведены на рис. 2. При расчете этих функций использовались зависимости теплоемкости и удельного сопротивления металлов от температуры, взятые из работ [5-8].

Итак, нами показано, что расход массы конического эмиттера при прочих равных условиях однозначно определяется величиной удельного интеграла действия металла.

Список литературы

- [1] Литвинов Е.А. Автореф. докт. дис. Томск, ИСЭ СО АН СССР. 1981.
- [2] Котов Ю.А. Автореф. докт. дис. Томск, ИСЭ СО АН СССР. 1986.
- [3] Месяц В.Г. Автореф. канд. дис. Томск, ИСЭ СО АН СССР. 1989.
- [4] Месяц В.Г., Шкуратов С.И. Эмиссия электронов из ВТСП в условиях высоких электрических полей. Препринт УрО АН СССР. 1988. № 6.
- [5] Новицкий Л.А., Кожевников И.Г. Теплофизические свойства материалов при низких температурах. М.: Машиностроение, 1975.
- [6] Пелецкий В.Э., Бельская Э.А. Электрическое сопротивление тугоплавких материалов. Энергоиздат, 1981.
- [7] Таблицы физических величин /Под ред. Кикоина И.К. М.: Атомиздат, 1976.
- [8] Старцев В.Е. Автореф. канд. дис. Свердловск, ИФМ. 1968.

Поступило в Редакцию
6 апреля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 14

26 июля 1990 г.

06.2

© 1990

ЛЕГИРОВАНИЕ АЗОТОМ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ SiC
ПРИ РОСТЕ СУБЛИМАЦИОННЫМ „СЭНДВИЧ-МЕТОДОМ
В ВАКУУМЕ

Е.Н. Мухов, М.Г. Рамм, А.Д. Розенков,
М.И. Федоров, Р.Г. Веренчикова

Формирование приборных структур на базе SiC с требуемым распределением примеси встречает серьезные трудности, которые обычно связываются с недостаточным контролем паровой фазы в